Документ полтисан простой алектронной полтиство НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Информация о владельце:

ФИО: Исаев Игорь Магомедович

Должность: Проректо Редеральное учреждение автономное образовательное учреждение

Дата подписания: 12.10.2023 12:49:17 высшего образования

Уникальный профрациональный исследовательский технологический университет «МИСИС»

d7a26b9e8ca85e98ec3de2eb454b4659d061f249

### Рабочая программа дисциплины (модуля)

# Физика квантоворазмерных полупроводниковых композиций

Закреплена за подразделением Кафедра технологии материалов электроники

Направление подготовки 11.03.04 ЭЛЕКТРОНИКА И НАНОЭЛЕКТРОНИКА

Профиль

Квалификация Инженер-исследователь

 Форма обучения
 очная

 Общая трудоемкость
 4 ЗЕТ

Часов по учебному плану 144 Формы контроля в семестрах:

в том числе:
аудиторные занятия 51
самостоятельная работа 57
часов на контроль 36

зачет с оценкой 9

курсовая работа 9

### Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	9 (5.1)			Итого	
Недель	1	8			
Вид занятий	УП	УП РП		РΠ	
Лекции	34	34	34	34	
Практические	17 17		17	17	
Итого ауд.	51 51 51		51		
Контактная работа	51	51	51	51	
Сам. работа	57	57	57	57	
Часы на контроль	36 36		36	36	
Итого	144	144	144	144	

#### Программу составил(и):

ктн, Доцент, Сергиенко Андрей Алексеевич;ктн, Доцент, Курочка Александр Сергеевич

#### Рабочая программа

#### Физика квантоворазмерных полупроводниковых композиций

Разработана в соответствии с ОС ВО:

Самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС» по направлению подготовки 11.03.04 ЭЛЕКТРОНИКА И НАНОЭЛЕКТРОНИКА (приказ от 28.06.2023 г. № 292 о.в.)

Составлена на основании учебного плана:

11.03.04 ЭЛЕКТРОНИКА И НАНОЭЛЕКТРОНИКА, 11.03.04-БЭН-23\_6-ПП.plx , утвержденного Ученым советом НИТУ МИСИС в составе соответствующей ОПОП ВО 22.06.2023, протокол № 5-23

Утверждена в составе ОПОП ВО:

11.03.04 ЭЛЕКТРОНИКА И НАНОЭЛЕКТРОНИКА, , утвержденной Ученым советом НИТУ МИСИС 22.06.2023, протокол № 5-23

Рабочая программа одобрена на заседании

Кафедра технологии материалов электроники

Протокол от 29.06.2023 г., №10

Руководитель подразделения Костишин В. Г.

### 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ

1.1 Цель — подготовить выпускников к научно-исследовательской деятельности, связанной с рассмотрением таких вопросов как основные полупроводниковые материалы, многокомпонентные наногетероструктуры и методы нанотехнологий применительно к созданию элементной базы наноэлектроники, оптоэлектроники, квантовых приборов и устройств.

		2. МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ						
<ul> <li>2.1.1 Вакуумивя и плазменная электронике</li> <li>2.1.2 Квытговоряжерные структуры в наноэлектронике</li> <li>2.1.3 Манитные измерения</li> <li>2.1.4 Математические модели технологических процессов получения магнитоэлектронной и радиокерамики</li> <li>2.1.5 Моделирование производства ферритовых приборов и устройств</li> <li>2.1.6 Наизолектронныя полупроводниковых приборов и устройств</li> <li>2.1.7 Оборудование производства ферритовых магериалов и радиокерамики</li> <li>2.1.8 Основы радиационной стойкости изделий электронной техники</li> <li>2.1.9 Основы технологии электронной компонентной базы</li> <li>2.1.10 Приборы квантовой и оптической электронных</li> <li>2.1.11 Процессы вакуумной и плазменной электронных</li> <li>2.1.12 Технология производства ферритовых материалов и радиокерамики</li> <li>2.1.13 Физика вазимодействия частии и излучений с пеществом</li> <li>2.1.14 Элементы и устройства магнитоэлектронных</li> <li>2.1.15 Дефекты в оптоэлектронных полупроводниковых приборах на широкозонных материалах</li> <li>2.1.16 Ноно-плазменная обработка магериалов</li> <li>2.1.17 Компьютерные технологии проектирования процессов напоэлектроники</li> <li>2.1.18 Материаловедение ферритов и родственных магнитных систем</li> <li>2.1.19 Моно-плазменная обработка магериалов</li> <li>2.1.10 Основы проектирования электронной компонентной базы. Пакеты прикладных программ</li> <li>2.1.21 Основы проектирования электронной компонентной базы. Пакеты прикладных программ</li> <li>2.1.22 Полевые полупроводниковые приборы</li> <li>2.1.23 Полупроводниковая напоэлектронных</li> <li>2.1.24 Физико-математического оклучения</li> <li>2.1.25 Физико-математического оклучения</li> <li>2.1.26 Физико-математического оклучения</li> <li>2.1.27 Физические основы электронной</li> <li>2.1.28 Функциональная наноэлектроники</li> <li>2.1.29 Бигопарные полупроводниковые приборы</li> <li>2.1.30 Инженерная математика</li> <li>2.1.31 Квантовая и оптическая электронной лектронки и дамасктроники</li> <li>2.1.32 Мариа математика</li> <li>3.1.34 Мариа</li></ul>		Блок ОП: Б1.В.ДВ.14						
<ul> <li>2.1.1 Вакуумивя и плазменная электронике</li> <li>2.1.2 Квытговоряжерные структуры в наноэлектронике</li> <li>2.1.3 Манитные измерения</li> <li>2.1.4 Математические модели технологических процессов получения магнитоэлектронной и радиокерамики</li> <li>2.1.5 Моделирование производства ферритовых приборов и устройств</li> <li>2.1.6 Наизолектронныя полупроводниковых приборов и устройств</li> <li>2.1.7 Оборудование производства ферритовых магериалов и радиокерамики</li> <li>2.1.8 Основы радиационной стойкости изделий электронной техники</li> <li>2.1.9 Основы технологии электронной компонентной базы</li> <li>2.1.10 Приборы квантовой и оптической электронных</li> <li>2.1.11 Процессы вакуумной и плазменной электронных</li> <li>2.1.12 Технология производства ферритовых материалов и радиокерамики</li> <li>2.1.13 Физика вазимодействия частии и излучений с пеществом</li> <li>2.1.14 Элементы и устройства магнитоэлектронных</li> <li>2.1.15 Дефекты в оптоэлектронных полупроводниковых приборах на широкозонных материалах</li> <li>2.1.16 Ноно-плазменная обработка магериалов</li> <li>2.1.17 Компьютерные технологии проектирования процессов напоэлектроники</li> <li>2.1.18 Материаловедение ферритов и родственных магнитных систем</li> <li>2.1.19 Моно-плазменная обработка магериалов</li> <li>2.1.10 Основы проектирования электронной компонентной базы. Пакеты прикладных программ</li> <li>2.1.21 Основы проектирования электронной компонентной базы. Пакеты прикладных программ</li> <li>2.1.22 Полевые полупроводниковые приборы</li> <li>2.1.23 Полупроводниковая напоэлектронных</li> <li>2.1.24 Физико-математического оклучения</li> <li>2.1.25 Физико-математического оклучения</li> <li>2.1.26 Физико-математического оклучения</li> <li>2.1.27 Физические основы электронной</li> <li>2.1.28 Функциональная наноэлектроники</li> <li>2.1.29 Бигопарные полупроводниковые приборы</li> <li>2.1.30 Инженерная математика</li> <li>2.1.31 Квантовая и оптическая электронной лектронки и дамасктроники</li> <li>2.1.32 Мариа математика</li> <li>3.1.34 Мариа</li></ul>	2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:						
2.1.3 Магиятные измерения     2.1.4 Мятематические модели технологических процессов получения магинтолектроники и радиокерамики     2.1.5 Моделирование технологических процессов получения материалов электронной техники     2.1.6 Наноэлектронных полупроводниковых приборов и устройств     2.1.7 Оборудование производства ферритовых материалов и радиокерамики     2.1.8 Основы гехнологии электронной компонентной базы     2.1.9 Основы гехнологии электронной компонентной базы     2.1.10 Приборы квантовой и оптической электроники     2.1.11 Процессы вакуумной и плаженной электроники     2.1.12 Процессы вакуумной и плаженной электроники     2.1.13 Физика взаимодействия частиц и излучений с веществом     2.1.14 Заженты и устройства магинтольскуроники     2.1.15 Дейскты поитольскуронных     2.1.16 Ионно-плазменная обработка материалов и радиокерамики     3.1.17 Компьютерные технологии проектирования процессов наноэлектроники     3.1.18 Материаловедение ферритов и родственных магинтных систем     4.1.19 Методы исследования митериалов и структур электроники     3.1.10 Основы проектирования электронной компонентной базы. Пакеты прикладиых программ     4.1.21 Основы проектирования электронной компонентной базы. Тахнология тонких пленок     4.1.21 Полупроводниковая наноэлектронной компонентной базы. Тахнология тонких пленок     4.1.22 Полупроводниковая наноэлектронной компонентной базы. Тахнология тонких пленок     4.1.23 Полупроводниковая наноэлектронной компонентной базы. Тахнология тонких пленок     5.1.24 Приемники оптического излучения     5.1.25 Физико-математические модели процессов наноэлектроники     7.1.26 Физико-математические модели процессов наноэлектроники     7.1.27 Физико-математические модели процессов наноэлектроники     7.1.28 Биголарные полупроводниковые приборы     8.1.32 Материаловодение полупроводниковые приборы     7.1.33 Ижженерная математика     7.1.34 Биголарные полупроводниковые приборы     7.1.35 Физика нанажений выстрежений электроники     7.1.36 Физика магинтных явлений электронной электрон	2.1.1							
2.1.4         Математические модели технологических процессов получения магнитоэлектроники и раднокерамики           2.1.5         Моделирование технологических процессов получения материалов электронной техники           2.1.6         Наноэлектроннка полупроводниковых приборов и устройств           2.1.7         Оборудование производства ферритовых материалов и раднокерамики           2.1.8         Основы радиационной стойкости изделий электронной техники           2.1.9         Основы технологии электронной компонентной базы           2.1.10         Приборы квантовой и отитической электронноки           2.1.11         Пропессы вакуумной и плаэмениюй электроники           2.1.12         Технология производства ферритовых материалов и радиокерамики           2.1.13         Физика взаимодействия частиц и излучений с веществом           2.1.14         Элементы и устройства магнитоэлектроники           2.1.15         Дефекты в оптоэлектроники материалов           2.1.16         Ионно-плаяменная обработка материалов           2.1.17         Компьютерные технологии просктирования процессов наноэлектроники           2.1.18         Материаловедение ферритов и родственных магнитных систем           2.1.20         Основы пресктирования электронной компонентной базы. Технология тонких пленок           2.1.21         Основы пресктирования электронной компонентной базы. Технология тонких пленок           2.1.22	2.1.2	Квантоворазмерные структуры в наноэлектронике						
<ul> <li>2.1.5 Моделирование технологических процессов получения материалов электронной техники</li> <li>2.1.6 Наиоэлектроника полупроводниковых приборов и устройств</li> <li>2.1.7 Обсюдудование производства ферритовых материалов и раднокерамики</li> <li>2.1.8 Основы радившиовной стойкости изделий электронной техники</li> <li>2.1.9 Основы технологии электронной компонентной базы</li> <li>2.1.10 Приборы квантовой и пламенной электроники</li> <li>2.1.11 Процессы вакуумной и пламенной электроники</li> <li>2.1.12 Технология производства ферритовых материалов и раднокерамики</li> <li>2.1.13 Физика взаимодействия частиц и излучений с веществом</li> <li>2.1.14 Элементы и устройства материалов</li> <li>2.1.15 Дефекты в оптоэлектронных полупроводниковых приборах на широкозонных материалах</li> <li>2.1.16 Ионно-пламенная обработка материалов</li> <li>2.1.17 Компьютерные технологии проектировании процессов наноэлектроннки</li> <li>2.1.18 Материаловедение ферритов и родственных матитных систем</li> <li>2.1.19 Методы исследования материалов и структур электроники</li> <li>2.1.20 Основы проектирования электронной компонентной базы. Пакеты прикладных программ</li> <li>2.1.21 Основы проектирования электронной компонентной базы. Технология тонких пленок</li> <li>2.1.22 Полевые полупроводниковые приборы</li> <li>2.1.23 Полупроводниковая наноэлектроника</li> <li>2.1.24 Физика импудьеного отжига</li> <li>2.1.25 Физика матурысного отжига</li> <li>2.1.26 Физика импудьеного отжига</li> <li>2.1.27 Физические основы электронники</li> <li>2.1.28 Биюлярные полупроводниковые приборы</li> <li>2.1.29 Биюлярные полупроводниковые приборы</li> <li>2.1.31 Кавитовах и оптическая электроника</li> <li>2.1.32 Материаловедение полупроводниковы приборы</li> <li>2.1.33 Ремноговарсные полупроводников электроники</li> <li>Физика дизискериалья электронной техники</li> <li>Физика дизискериалья электронной техники</li> <li>Физика ди</li></ul>	2.1.3	Магнитные измерения						
<ul> <li>2.1.5 Моделирование технологических процессов получения материалов электронной техники</li> <li>2.1.6 Наиоэлектроника полупроводниковых приборов и устройств</li> <li>2.1.7 Обсюдудование производства ферритовых материалов и раднокерамики</li> <li>2.1.8 Основы радившиовной стойкости изделий электронной техники</li> <li>2.1.9 Основы технологии электронной компонентной базы</li> <li>2.1.10 Приборы квантовой и пламенной электроники</li> <li>2.1.11 Процессы вакуумной и пламенной электроники</li> <li>2.1.12 Технология производства ферритовых материалов и раднокерамики</li> <li>2.1.13 Физика взаимодействия частиц и излучений с веществом</li> <li>2.1.14 Элементы и устройства материалов</li> <li>2.1.15 Дефекты в оптоэлектронных полупроводниковых приборах на широкозонных материалах</li> <li>2.1.16 Ионно-пламенная обработка материалов</li> <li>2.1.17 Компьютерные технологии проектировании процессов наноэлектроннки</li> <li>2.1.18 Материаловедение ферритов и родственных матитных систем</li> <li>2.1.19 Методы исследования материалов и структур электроники</li> <li>2.1.20 Основы проектирования электронной компонентной базы. Пакеты прикладных программ</li> <li>2.1.21 Основы проектирования электронной компонентной базы. Технология тонких пленок</li> <li>2.1.22 Полевые полупроводниковые приборы</li> <li>2.1.23 Полупроводниковая наноэлектроника</li> <li>2.1.24 Физика импудьеного отжига</li> <li>2.1.25 Физика матурысного отжига</li> <li>2.1.26 Физика импудьеного отжига</li> <li>2.1.27 Физические основы электронники</li> <li>2.1.28 Биюлярные полупроводниковые приборы</li> <li>2.1.29 Биюлярные полупроводниковые приборы</li> <li>2.1.31 Кавитовах и оптическая электроника</li> <li>2.1.32 Материаловедение полупроводниковы приборы</li> <li>2.1.33 Ремноговарсные полупроводников электроники</li> <li>Физика дизискериалья электронной техники</li> <li>Физика дизискериалья электронной техники</li> <li>Физика ди</li></ul>	2.1.4	Математические модели технологических процессов получения магнитоэлектроники и радиокерамики						
2.1.7 Оборудование производства ферритовых материалов и радиокерамики     2.1.8 Основы радиационной стойкости изделий электронной техники     2.1.9 Основы технологии электронной компонентной базы     2.1.10 Приборы квантовой и оптической электроники     2.1.11 Процессы вакуумной и плазменной электроники     2.1.12 Технология производства ферритовых материалов и радиокерамики     2.1.13 Физика взаимодействия частиц и излучений с веществом     3.1.14 Элементы и устройства магнитоэлектронный     2.1.15 Дефекты в оптоэлектронных полупроводниковых приборах на широкозонных материалах     2.1.16 Ионно-плазменная обработка материалов     2.1.17 Компьютерные технологии проектирования процессов наноэлектронных     2.1.18 Материаловедение ферритов и родственных магнитных светем     2.1.19 Методы исследования материалов и структур электроники     2.1.20 Основы проектирования электронной компонентной базы. Пакеты прикладных программ     2.1.21 Основы технологии электронной компонентной базы. Технология тонких пленок     2.1.22 Полупроводниковая наноэлектронных     2.1.23 Полупроводниковая наноэлектронной компонентной базы. Технология тонких пленок     2.1.24 Приемники оптического излучения     2.1.25 Физика милупьсного отжига     3.1.26 Физика милупьсного отжига     3.1.27 Физика милупьсного отжига     4.1.28 Функциональная наноэлектронники     3.1.29 Биполярные полупроводниковые приборы     3.1.30 Инженерная математические модели процессов наноэлектроники     3.1.31 Квантовая и оптическая электроннок     3.1.32 Материаловедение полупроводников и дизлектриков     3.1.33 Очижа дизлектриков     4.1.34 Физика магнатика     4.1.35 Физика магнатика магематика     3.1.36 Физика магнатика магематика     4.1.37 Физика магнатика магематика     4.1.38 Метрология, стандартизация и технические измерения в магнитозлектронике     4.1.39 Метрология, стандартизация и технические измерения в полупроводниковой электронике	2.1.5							
2.1.8         Основы радивационной стойкости изделий электронной техники           2.1.9         Основы технологии электронной компонентной базы           2.1.10         Приборы квантовой и оптической электроники           2.1.11         Процессы вакуумной и плажиенной электроники           2.1.12         Технология производства ферритовых материалов и радиокерамики           2.1.13         Физика взаимодействия частиц и излучений с веществом           2.1.14         Элементы и устройства магнитоэлектроники           2.1.15         Дефекты в оптоэлектронных полупроводниковых приборах на широкозонных материалах           2.1.16         Ионно-плазменная обработка материалов           2.1.17         Компьютерные технологии проектирования процессов наноэлектроники           2.1.18         Материаловедение ферритов и родственных магнитных систем           2.1.19         Методы исследования материалов и структур электроники           2.1.20         Основы проектирования магериалов и структур электроники           2.1.21         Основы проектирования магериалов и структур электроники           2.1.22         Полупроводниковы приборы           2.1.23         Полупроводниковы приборы           2.1.24         Приемники оптического излучения           2.1.25         Физико-математические модел процессов наноэлектроники           2.1.26         Физико-математические модел	2.1.6	Наноэлектроника полупроводниковых приборов и устройств						
2.1.10         Основы технологии электронной компонентной базы           2.1.10         Приборы квантовой и отпической электроники           2.1.11         Процессы вакуумной и плазменной электроники           2.1.12         Технология производства ферритовых материалов и радиокерамики           2.1.13         Физика взаимодействия частиц и издучений с веществом           2.1.14         Элементы и устройства магнитоэлектроники           2.1.15         Дефекты в оптоэлектронных полупроводниковых приборах на широкозонных материалах           2.1.16         Ионно-плазменная обработка материалов           2.1.17         Компьютерные технологии проектирования процессов наноэлектроники           2.1.18         Материаловедение ферритов и родственных магинтных систем           2.1.19         Методы исследования магериалов и структур электроники           2.1.20         Основы проектирования электронной компонентной базы. Пакеты прикладных программ           2.1.21         Основы проектироводниковые приборы           2.1.22         Полевые полупроводниковая наноэлектроника           2.1.23         Полупроводниковая наноэлектроника           2.1.24         Приемники оптического излучения           2.1.25         Физика вимульнова полупроводниковы приборы           2.1.26         Физика магемтатические модели процессов наноэлектроники           2.1.27         Физика ным	2.1.7	Оборудование производства ферритовых материалов и радиокерамики						
2.1.10         Приборы квантовой и оптической электроники           2.1.11         Процессы вакуумной и плазменной электроники           2.1.12         Технология производства ферритовых материалов и радиокерамики           2.1.13         Физика взаимодействия частиц и излучений с веществом           2.1.14         Элементы и устройства магнитоэлектроники           2.1.15         Дефекты в оптоэлектронных полупроводниковых приборах на широкозонных материалах           2.1.16         Ионно-плазменная обработка материалов           2.1.17         Компьютерные технологии проеметирования процессов наноэлектроники           2.1.18         Материаловедение ферритов и родственных магинтных систем           2.1.19         Методы исследования материалов и структур электроники           2.1.20         Основы проектирования электронной компонентной базы. Пакеты прикладных программ           2.1.21         Основы гехнологии электронной компонентной базы. Технология тонких пленок           2.1.22         Полупроводниковые приборы           2.1.23         Полупроводниковые пантолектроника           2.1.24         Присминки оптического излучения           2.1.25         Физико-магематические модели процессов наноэлектроники           2.1.26         Физико-магематические модели процессов наноэлектроники           2.1.27         Физике минуправодниковые приборы           2.1.30	2.1.8	Основы радиационной стойкости изделий электронной техники						
2.1.11 Процессы вакуумной и плазменной электроники     2.1.12 Технология производства ферритовых материалов и радиокерамики     2.1.13 Физика взаимодействия частиц и излучений с веществом     2.1.14 Элементы и устройства магнитоэлектроники     2.1.15 Дефекты в оптоэлектронных полупроводниковых приборах на широкозонных материалах     2.1.16 Ионно-плазменная обработка материалов     2.1.17 Компьютерные технологии проектирования процессов наноэлектроники     2.1.18 Материаловедение ферритов и родственных магнитных систем     2.1.19 Методы исследования материалов и структур электроники     2.1.20 Основы проектирования электронной компонентной базы. Пакеты прикладных программ     2.1.21 Основы технологии электронной компонентной базы. Технология тонких пленок     2.1.22 Полевые полупроводниковые приборы     2.1.23 Полупроводниковая наноэлектроника     2.1.24 Приемники оптического излучения     2.1.25 Физико-математические модели процессов наноэлектроники     2.1.27 Физические основы электроники     2.1.28 Функциональная наноэлектроники     2.1.29 Биполярные полупроводниковые приборы     2.1.29 Биполярные полупроводниковые приборы     2.1.21 Квантовая и оптическая электроника     2.1.22 Кантовая и оптическая электроника     2.1.33 Квантовая и оптическая электроника     2.1.34 Физика диэлектриков     2.1.35 Физика конденсированного состояния     2.1.36 Физика материалов электронной техники     2.1.37 Физика диэлектриков     2.1.38 Физика конденсированного состояния     2.1.39 Физика конденсированного состояния     2.1.31 Кантовая и оптическая электронной техники     2.1.32 Физика конденсированного состояния     2.1.33 Физика конденсированного состояния     2.1.34 Физика магнитных явлений     2.1.35 Физика конденсированного состояния     2.1.36 Физика магнитных явлений     2.1.37 Актуальные проблемы современной электроники и наноэлектроники     2.1.38 Метрология, стандартизация и технические измерения в магнитоэлектронике     2.1.39 Метрология, стандартизация и технические измерения в полупроводниковой электроник	2.1.9	Основы технологии электронной компонентной базы						
2.1.12 Технология производства ферритовых материалов и радиокерамики     2.1.13 Физика взаимодействия частиц и излучений с веществом     2.1.14 Элементы и устройства магнитоэлектроники     2.1.15 Дефекты в оптоэлектронных полупроводниковых приборах на широкозонных материалах     2.1.16 Ионно-плазменная обработка материалов     2.1.17 Компьютерные технологии проектирования процессов наноэлектроники     2.1.18 Материаловедение ферритов и родственных магнитных систем     2.1.19 Методы исследования материалов и структур электроннки     2.1.20 Основы проектирования электронной компонентной базы. Пакеты прикладных программ     2.1.21 Основы технологии электронной компонентной базы. Технология тонких пленок     2.1.22 Полевые полупроводниковые приборы     2.1.23 Полупроводниковые приборы     2.1.24 Приемники оптического излучения     2.1.25 Физика импульсного отжига     2.1.26 Физика импульсного отжига     2.1.27 Физические основы электроники     2.1.28 Функциональная наноэлектроника     2.1.29 Биполярные полупроводниковые приборы     2.1.20 Инженерная математика     2.1.31 Квантовая и оптическая электроника     2.1.32 Материаловедение полупроводников и диэлектриков     2.1.33 Технология материалов электронной техники     2.1.34 Физика конденсированного состояния     2.1.35 Физика конденсированного состояния     2.1.36 Физика магнитных явлений     2.1.37 Актуальные проблемы современной электроники и наноэлектроники     2.1.38 Метрология, стандартизация и технические измерения в магнитоэлектронике     3.1.39 Метрология, стандартизация и технические измерения в магнитоэлектронике	2.1.10	Приборы квантовой и оптической электроники						
2.1.13 Физика взаимодействия частиц и излучений с веществом     2.1.14 Элементы и устройства магнитоэлектроники     2.1.15 Дефекты в оптоэлектронных полупроводниковых приборах на широкозонных материалах     2.1.16 Ионно-плазменная обработка материалов     2.1.17 Компьютерные технологии проектирования процессов наноэлектроники     2.1.18 Материаловедение ферритов и родственных магнитных систем     2.1.19 Методы исследования материалов и структур электроники     2.1.20 Основы проектирования электронной компонентной базы. Паксты прикладных программ     2.1.21 Основы технологии электронной компонентной базы. Технология тонких пленок     2.1.22 Полевые полупроводниковые приборы     2.1.23 Полупроводниковая наноэлектроника     2.1.24 Приемники оптического излучения     2.1.25 Физика импульеного отжига     2.1.26 Физика импульеного отжига     2.1.27 Физические основы электроники     2.1.28 Функциональная наноэлектроника     2.1.29 Биполярные полупроводниковые приборы     2.1.29 Биполярные полупроводниковые приборы     2.1.30 Инженерная математика     2.1.31 Квантовая и оптическая электроника     2.1.33 Материаловедение полупроводников и дизлектриков     2.1.33 Технология материалов электронной техники     2.1.34 Физика конденсированного состояния     2.1.35 Физика конденсированного состояния     2.1.36 Физика магичитных явлений     2.1.37 Актуальные проблемы современной электронники и наноэлектроники     2.1.38 Метрология, стандартизация и технические измерения в магнитоэлектронике     3.1.39 Метрология, стандартизация и технические измерения в полупроводниковой электронике	2.1.11	Процессы вакуумной и плазменной электроники						
2.1.14 Элементы и устройства магнитоэлектроники     2.1.15 Дефекты в оптоэлектронных полупроводниковых приборах на широкозонных материалах     2.1.16 Ионно-плазменная обработка материалов     2.1.17 Компьютерные технологии проектирования процессов наноэлектроники     2.1.18 Материаловедение ферритов и родственных магнитных систем     2.1.19 Методы исследования материалов и структур электроники     2.1.20 Основы проектирования электронной компонентной базы. Пакеты прикладных программ     2.1.21 Основы технологии электронной компонентной базы. Технология тонких пленок     2.1.22 Полевые полупроводниковые приборы     2.1.23 Полупроводниковая наноэлектроника     2.1.24 Приемники оптического излучения     2.1.25 Физика импульсного отжига     2.1.26 Физика импульсного отжига     2.1.27 Физические основы электроники     2.1.28 Функциональная наноэлектроника     2.1.29 Биполярные полупроводниковые приборы     2.1.30 Инженерная математика     2.1.31 Квантовая и оптическая электроника     2.1.32 Материаловедение полупроводников и диэлектриков     2.1.33 Технология материалов электронию техники     2.1.34 Физика конденсированного состояния     2.1.35 Физика конденсированного состояния     2.1.36 Физика магнитных явлений     2.1.37 Актуальные проблемы современной электроники и наноэлектроники     2.1.38 Метрология, стандартизация и технические измерения в магнитоэлектронике     3.1.39 Метрология, стандартизация и технические измерения в магнитоэлектронике	2.1.12	Технология производства ферритовых материалов и радиокерамики						
2.1.15 Дефекты в оптоэлектронных полупроводниковых приборах на широкозонных материалах     2.1.16 Ионно-плазменная обработка материалов     2.1.17 Компьютерные технологии проектирования процессов наноэлектроники     2.1.18 Материаловедение ферритов и родственных магнитных систем     2.1.19 Методы исследования материалов и структур электроники     2.1.20 Основы проектирования электронной компонентной базы. Пакеты прикладных программ     2.1.21 Основы проектирования электронной компонентной базы. Технология тонких пленок     1.1.22 Полевые полупроводниковые приборы     2.1.23 Полупроводниковая наноэлектроника     2.1.24 Приемники оптического излучения     2.1.25 Физика импульсного отжига     2.1.26 Физико-математические модели процессов наноэлектроники     2.1.27 Физические основы электроники     2.1.28 Функциональная наноэлектроника     2.1.29 Биполярные полупроводниковые приборы     2.1.30 Инженерная математика     2.1.31 Квантовая и оптическая электроника     2.1.32 Материаловедение полупроводников и диэлектриков     2.1.33 Технология материалов электронной техники     2.1.34 Физика конденсированного состояния     2.1.35 Физика конденсированного состояния     2.1.36 Физика конденсированного состояния     2.1.37 Актуальные проблемы современной электроники и наноэлектроники     2.1.38 Метрология, стандартизация и технические измерения в магнитоэлектронике     3.1.39 Метрология, стандартизация и технические измерения в магнитоэлектронике	2.1.13	Физика взаимодействия частиц и излучений с веществом						
2.1.16       Ионно-плазменная обработка материалов         2.1.17       Компьютерные технологии проектирования процессов наноэлектроники         2.1.18       Материаловедение ферритов и родственных магнитных систем         2.1.19       Методы исследования материалов и структур электроники         2.1.20       Оеновы проектирования электронной компонентной базы. Пакеты прикладных программ         2.1.21       Основы технологии электронной компонентной базы. Технология тонких пленок         2.1.22       Полевые полупроводниковая наноэлектроника         2.1.23       Полупроводниковая наноэлектроника         2.1.24       Приемники оптического излучения         2.1.25       Физика импульсного отжига         2.1.26       Физика основы электроники         2.1.27       Физические основы электроники         2.1.28       Функциональная наноэлектроника         2.1.29       Биполярные полупроводниковые приборы         2.1.30       Инженерная математика         2.1.31       Квантовая и оптическая электроника         2.1.32       Материаловедение полупроводников и диэлектриков         2.1.33       Технология материалов электронной техники         2.1.34       Физика конденсированного состояния         2.1.35       Физика конденсированного состояния         2.1.36       Физика конденсированного сост	2.1.14	Элементы и устройства магнитоэлектроники						
2.1.17       Компьютерные технологии проектирования процессов наноэлектроники         2.1.18       Материаловедение ферритов и родственных магнитных систем         2.1.19       Методы исследования материалов и структур электроники         2.1.20       Основы проектирования электронной компонентной базы. Пакеты прикладных программ         2.1.21       Основы технологии электронной компонентной базы. Технология тонких пленок         2.1.22       Полевые полупроводниковые приборы         2.1.23       Полупроводниковая наноэлектроника         2.1.24       Приемники оптического излучения         2.1.25       Физика мипульсного отжига         2.1.26       Физико-математические модели процессов наноэлектроники         2.1.27       Физика математические основы электроника         2.1.28       Функциональная наноэлектроника         2.1.29       Биполярные полупроводниковые приборы         2.1.30       Инженерная математика         2.1.31       Квантовая и оптическая электроника         2.1.32       Материаловедение полупроводников и диэлектриков         2.1.33       Технология материалов электронной техники         2.1.34       Физика монденсированного состояния         2.1.35       Физика монденсированного состояния         2.1.36       Физика монденсированного состояния         2.1.37	2.1.15	Дефекты в оптоэлектронных полупроводниковых приборах на широкозонных материалах						
2.1.18       Материаловедение ферритов и родственных магнитных систем         2.1.19       Методы исследования материалов и структур электроники         2.1.20       Основы проектирования электронной компонентной базы. Пакеты прикладных программ         2.1.21       Основы технологии электронной компонентной базы. Технология тонких пленок         2.1.22       Полевые полупроводниковые приборы         2.1.23       Полупроводниковая наноэлектроника         2.1.24       Приемники оптического излучения         2.1.25       Физика импульсного отжига         2.1.26       Физико-математические модели процессов наноэлектроники         2.1.27       Физико-математические модели процессов наноэлектроники         2.1.28       Функциональная наноэлектроника         2.1.29       Биполярные полупроводниковые приборы         2.1.30       Инженерная математика         2.1.31       Квантовая и оптическая электроника         2.1.32       Материаловедение полупроводников и диэлектриков         2.1.33       Технология материалов электронной техники         2.1.34       Физика конденсированного состояния         2.1.35       Физика магнитных явлений         2.1.37       Актуальные проблемы современной электроники и наноэлектроники         2.1.38       Метрология, стандартизация и технические измерения в магнитоэлектронике	2.1.16	Ионно-плазменная обработка материалов						
2.1.19       Методы исследования материалов и структур электроники         2.1.20       Основы проектирования электронной компонентной базы. Пакеты прикладных программ         2.1.21       Основы технологии электронной компонентной базы. Технология тонких пленок         2.1.22       Полевые полупроводниковая наноэлектроника         2.1.23       Полупроводниковая наноэлектроника         2.1.24       Приемники оптического излучения         2.1.25       Физика импульсного отжига         2.1.26       Физико-математические модели процессов наноэлектроники         2.1.27       Физико-математические модели процессов наноэлектроники         2.1.28       Функциональная наноэлектроника         2.1.29       Биполярные полупроводниковые приборы         2.1.30       Инженерная математика         2.1.31       Квантовая и оптическая электроника         2.1.32       Материаловедение полупроводников и диэлектриков         2.1.33       Технология материалов электронной техники         2.1.34       Физика диэлектриков         2.1.35       Физика конденсированного состояния         2.1.36       Физика магнитных явлений         2.1.37       Актуальные проблемы современной электроники и наноэлектроники         2.1.38       Метрология, стандартизация и технические измерения в магнитоэлектронике         2.1.39	2.1.17	Компьютерные технологии проектирования процессов наноэлектроники						
2.1.20       Основы проектирования электронной компонентной базы. Пакеты прикладных программ         2.1.21       Основы технологии электронной компонентной базы. Технология тонких пленок         2.1.22       Полевые полупроводниковая приборы         2.1.23       Полупроводниковая наноэлектроника         2.1.24       Приемники оптического излучения         2.1.25       Физико-математические модели процессов наноэлектроники         2.1.26       Физико-математические модели процессов наноэлектроники         2.1.27       Физические основы электроники         2.1.28       Функциональная наноэлектроника         2.1.29       Биполярные полупроводниковые приборы         2.1.30       Инженерная математика         2.1.31       Квантовая и оптическая электроника         2.1.32       Материаловедение полупроводников и диэлектриков         2.1.33       Технология материалов электронной техники         2.1.34       Физика диэлектриков         2.1.35       Физика конденсированного состояния         2.1.36       Физика магнитных явлений         2.1.37       Актуальные проблемы современной электроники и наноэлектроники         2.1.38       Метрология, стандартизация и технические измерения в магнитоэлектронике         2.1.39       Метрология, стандартизация и технические измерения в полупроводниковой электронике <th>2.1.18</th> <th>Материаловедение ферритов и родственных магнитных систем</th>	2.1.18	Материаловедение ферритов и родственных магнитных систем						
2.1.21       Основы технологии электронной компонентной базы. Технология тонких пленок         2.1.22       Полевые полупроводниковые приборы         2.1.23       Полупроводниковая наноэлектроника         2.1.24       Приемники оптического излучения         2.1.25       Физика импульсного отжига         2.1.26       Физико-математические модели процессов наноэлектроники         2.1.27       Физические основы электроники         2.1.28       Функциональная наноэлектроника         2.1.29       Биполярные полупроводниковые приборы         2.1.30       Инженерная математика         2.1.31       Квантовая и оптическая электроника         2.1.32       Материаловедение полупроводников и диэлектриков         2.1.33       Технология материалов электронной техники         2.1.34       Физика диэлектриков         2.1.35       Физика конденсированного состояния         2.1.36       Физика магнитных явлений         2.1.37       Актуальные проблемы современной электроники и наноэлектроники         2.1.38       Метрология, стандартизация и технические измерения в магнитоэлектронике         2.1.39       Метрология, стандартизация и технические измерения в полупроводниковой электронике	2.1.19	Методы исследования материалов и структур электроники						
2.1.22       Полевые полупроводниковые приборы         2.1.23       Полупроводниковая наноэлектроника         2.1.24       Приемники оптического излучения         2.1.25       Физика импульсного отжига         2.1.26       Физико-математические модели процессов наноэлектроники         2.1.27       Физические основы электроники         2.1.28       Функциональная наноэлектроника         2.1.29       Биполярные полупроводниковые приборы         2.1.30       Инженерная математика         2.1.31       Квантовая и оптическая электроника         2.1.32       Материаловедение полупроводников и диэлектриков         2.1.33       Технология материалов электронной техники         2.1.34       Физика диэлектриков         2.1.35       Физика конденсированного состояния         2.1.36       Физика магнитных явлений         2.1.37       Актуальные проблемы современной электроники и наноэлектроники         2.1.38       Метрология, стандартизация и технические измерения в магнитоэлектронике         2.1.39       Метрология, стандартизация и технические измерения в полупроводниковой электронике	2.1.20	Основы проектирования электронной компонентной базы. Пакеты прикладных программ						
2.1.23       Полупроводниковая наноэлектроника         2.1.24       Приемники оптического излучения         2.1.25       Физика импульсного отжига         2.1.26       Физико-математические модели процессов наноэлектроники         2.1.27       Физические основы электроники         2.1.28       Функциональная наноэлектроника         2.1.29       Биполярные полупроводниковые приборы         2.1.30       Инженерная математика         2.1.31       Квантовая и оптическая электроника         2.1.32       Материаловедение полупроводников и диэлектриков         2.1.33       Технология материалов электронной техники         2.1.34       Физика диэлектриков         2.1.35       Физика конденсированного состояния         2.1.36       Физика магнитных явлений         2.1.37       Актуальные проблемы современной электроники и наноэлектроники         2.1.38       Метрология, стандартизация и технические измерения в магнитоэлектронике         2.1.39       Метрология, стандартизация и технические измерения в полупроводниковой электронике	2.1.21	Основы технологии электронной компонентной базы. Технология тонких пленок						
2.1.24       Приемники оптического излучения         2.1.25       Физика импульсного отжига         2.1.26       Физико-математические модели процессов наноэлектроники         2.1.27       Физические основы электроники         2.1.28       Функциональная наноэлектроника         2.1.29       Биполярные полупроводниковые приборы         2.1.30       Инженерная математика         2.1.31       Квантовая и оптическая электроника         2.1.32       Материаловедение полупроводников и диэлектриков         2.1.33       Технология материалов электронной техники         2.1.34       Физика диэлектриков         2.1.35       Физика конденсированного состояния         2.1.36       Физика магнитных явлений         2.1.37       Актуальные проблемы современной электроники и наноэлектроники         2.1.38       Метрология, стандартизация и технические измерения в магнитоэлектронике         2.1.39       Метрология, стандартизация и технические измерения в полупроводниковой электронике	2.1.22	Полевые полупроводниковые приборы						
2.1.25       Физика импульсного отжига         2.1.26       Физико-математические модели процессов наноэлектроники         2.1.27       Физические основы электроники         2.1.28       Функциональная наноэлектроника         2.1.29       Биполярные полупроводниковые приборы         2.1.30       Инженерная математика         2.1.31       Квантовая и оптическая электроника         2.1.32       Материаловедение полупроводников и диэлектриков         2.1.33       Технология материалов электронной техники         2.1.34       Физика диэлектриков         2.1.35       Физика конденсированного состояния         2.1.36       Физика магнитных явлений         2.1.37       Актуальные проблемы современной электроники и наноэлектроники         2.1.38       Метрология, стандартизация и технические измерения в магнитоэлектронике         2.1.39       Метрология, стандартизация и технические измерения в полупроводниковой электронике	2.1.23	Полупроводниковая наноэлектроника						
2.1.26       Физико-математические модели процессов наноэлектроники         2.1.27       Физические основы электроники         2.1.28       Функциональная наноэлектроника         2.1.29       Биполярные полупроводниковые приборы         2.1.30       Инженерная математика         2.1.31       Квантовая и оптическая электроника         2.1.32       Материаловедение полупроводников и диэлектриков         2.1.33       Технология материалов электронной техники         2.1.34       Физика диэлектриков         2.1.35       Физика конденсированного состояния         2.1.36       Физика магнитных явлений         2.1.37       Актуальные проблемы современной электроники и наноэлектроники         2.1.38       Метрология, стандартизация и технические измерения в магнитоэлектронике         2.1.39       Метрология, стандартизация и технические измерения в полупроводниковой электронике	2.1.24	Приемники оптического излучения						
2.1.27       Физические основы электроники         2.1.28       Функциональная наноэлектроника         2.1.29       Биполярные полупроводниковые приборы         2.1.30       Инженерная математика         2.1.31       Квантовая и оптическая электроника         2.1.32       Материаловедение полупроводников и диэлектриков         2.1.33       Технология материалов электронной техники         2.1.34       Физика диэлектриков         2.1.35       Физика конденсированного состояния         2.1.36       Физика магнитных явлений         2.1.37       Актуальные проблемы современной электроники и наноэлектроники         2.1.38       Метрология, стандартизация и технические измерения в магнитоэлектронике         2.1.39       Метрология, стандартизация и технические измерения в полупроводниковой электронике	2.1.25	Физика импульсного отжига						
2.1.28       Функциональная наноэлектроника         2.1.29       Биполярные полупроводниковые приборы         2.1.30       Инженерная математика         2.1.31       Квантовая и оптическая электроника         2.1.32       Материаловедение полупроводников и диэлектриков         2.1.33       Технология материалов электронной техники         2.1.34       Физика диэлектриков         2.1.35       Физика конденсированного состояния         2.1.36       Физика магнитных явлений         2.1.37       Актуальные проблемы современной электроники и наноэлектроники         2.1.38       Метрология, стандартизация и технические измерения в магнитоэлектронике         2.1.39       Метрология, стандартизация и технические измерения в полупроводниковой электронике	2.1.26	Физико-математические модели процессов наноэлектроники						
2.1.29       Биполярные полупроводниковые приборы         2.1.30       Инженерная математика         2.1.31       Квантовая и оптическая электроника         2.1.32       Материаловедение полупроводников и диэлектриков         2.1.33       Технология материалов электронной техники         2.1.34       Физика диэлектриков         2.1.35       Физика конденсированного состояния         2.1.36       Физика магнитных явлений         2.1.37       Актуальные проблемы современной электроники и наноэлектроники         2.1.38       Метрология, стандартизация и технические измерения в магнитоэлектронике         2.1.39       Метрология, стандартизация и технические измерения в полупроводниковой электронике	2.1.27	Физические основы электроники						
2.1.30       Инженерная математика         2.1.31       Квантовая и оптическая электроника         2.1.32       Материаловедение полупроводников и диэлектриков         2.1.33       Технология материалов электронной техники         2.1.34       Физика диэлектриков         2.1.35       Физика конденсированного состояния         2.1.36       Физика магнитных явлений         2.1.37       Актуальные проблемы современной электроники и наноэлектроники         2.1.38       Метрология, стандартизация и технические измерения в магнитоэлектронике         2.1.39       Метрология, стандартизация и технические измерения в полупроводниковой электронике	2.1.28	Функциональная наноэлектроника						
2.1.31       Квантовая и оптическая электроника         2.1.32       Материаловедение полупроводников и диэлектриков         2.1.33       Технология материалов электронной техники         2.1.34       Физика диэлектриков         2.1.35       Физика конденсированного состояния         2.1.36       Физика магнитных явлений         2.1.37       Актуальные проблемы современной электроники и наноэлектроники         2.1.38       Метрология, стандартизация и технические измерения в магнитоэлектронике         2.1.39       Метрология, стандартизация и технические измерения в полупроводниковой электронике	2.1.29	Биполярные полупроводниковые приборы						
2.1.32       Материаловедение полупроводников и диэлектриков         2.1.33       Технология материалов электронной техники         2.1.34       Физика диэлектриков         2.1.35       Физика конденсированного состояния         2.1.36       Физика магнитных явлений         2.1.37       Актуальные проблемы современной электроники и наноэлектроники         2.1.38       Метрология, стандартизация и технические измерения в магнитоэлектронике         2.1.39       Метрология, стандартизация и технические измерения в полупроводниковой электронике	2.1.30	Инженерная математика						
2.1.33       Технология материалов электронной техники         2.1.34       Физика диэлектриков         2.1.35       Физика конденсированного состояния         2.1.36       Физика магнитных явлений         2.1.37       Актуальные проблемы современной электроники и наноэлектроники         2.1.38       Метрология, стандартизация и технические измерения в магнитоэлектронике         2.1.39       Метрология, стандартизация и технические измерения в полупроводниковой электронике	2.1.31	Квантовая и оптическая электроника						
2.1.34       Физика диэлектриков         2.1.35       Физика конденсированного состояния         2.1.36       Физика магнитных явлений         2.1.37       Актуальные проблемы современной электроники и наноэлектроники         2.1.38       Метрология, стандартизация и технические измерения в магнитоэлектронике         2.1.39       Метрология, стандартизация и технические измерения в полупроводниковой электронике	2.1.32	Материаловедение полупроводников и диэлектриков						
2.1.35       Физика конденсированного состояния         2.1.36       Физика магнитных явлений         2.1.37       Актуальные проблемы современной электроники и наноэлектроники         2.1.38       Метрология, стандартизация и технические измерения в магнитоэлектронике         2.1.39       Метрология, стандартизация и технические измерения в полупроводниковой электронике	2.1.33	Технология материалов электронной техники						
2.1.36 Физика магнитных явлений     2.1.37 Актуальные проблемы современной электроники и наноэлектроники     2.1.38 Метрология, стандартизация и технические измерения в магнитоэлектронике     2.1.39 Метрология, стандартизация и технические измерения в полупроводниковой электронике	2.1.34	Физика диэлектриков						
<ul> <li>2.1.37 Актуальные проблемы современной электроники и наноэлектроники</li> <li>2.1.38 Метрология, стандартизация и технические измерения в магнитоэлектронике</li> <li>2.1.39 Метрология, стандартизация и технические измерения в полупроводниковой электронике</li> </ul>	2.1.35	Физика конденсированного состояния						
2.1.38 Метрология, стандартизация и технические измерения в магнитоэлектронике     2.1.39 Метрология, стандартизация и технические измерения в полупроводниковой электронике	2.1.36	Физика магнитных явлений						
2.1.39 Метрология, стандартизация и технические измерения в полупроводниковой электронике	2.1.37	Актуальные проблемы современной электроники и наноэлектроники						
		Метрология, стандартизация и технические измерения в магнитоэлектронике						
2.1.40 Статистическая физика								
	2.1.40	Статистическая физика						
2.1.41 Физические свойства кристаллов	2.1.41	Физические свойства кристаллов						
2.1.42 Электроника	2.1.42	Электроника						
2.1.43 Математическая статистика и анализ данных	2.1.43	Математическая статистика и анализ данных						
2.1.44 Методы математической физики	2.1.44	Методы математической физики						

2.1.45	Практическая кристаллография
2.1.46	Физика
2.1.47	Физическая химия
2.1.48	Математика
2.1.49	Органическая химия
2.1.50	Химия
2.2	Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
2.2.1	Материалы и элементы спинтроники и спинволновой электроники
2.2.2	Мессбауэровская спектроскопия материалов магнитоэлектроники и микросистемной техники
2.2.3	Микросхемотехника
2.2.4	Молекулярно-пучковая и МОС-гидридная технологии
2.2.5	Неразрушающие методы контроля процессов формирования гетерокомпозиций
2.2.6	Планирование научной деятельности
2.2.7	Приборные структуры на некристаллических материалах
2.2.8	Приборные структуры на широкозонных полупроводниках
2.2.9	Приборы и устройства на основе наносистем
2.2.10	Специальные вопросы физики магнитных явлений в конденсированных средах Часть 1
2.2.11	Технология наногетероструктур
2.2.12	Основы надежности элементной базы электроники в условиях ионизирующего излучения космического пространства
2.2.13	Проектирование и технология электронной компонентной базы
2.2.14	Радиационно-технологические процессы в электронике
2.2.15	Технологии материалов для радиопоглащения и электромагнитного экранирования
2.2.16	Физика и техника магнитной записи
2.2.17	Электроника органических полупроводников (материалы, технологии, приборы)
2.2.18	Электронные и оптические свойства широкозонных соединений А2В6
2.2.19	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.20	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.21	Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
2.2.22	Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы

#### 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, COOTHECEHHЫЕ С ФОРМИРУЕМЫМИ КОМПЕТЕНЦИЯМИ

# ПК-5: Способность проводить анализ и выбор перспективных технологических процессов при производстве изделий микроэлектроники

#### Знать:

ПК-5-31 физические свойства электронных систем различной размерности, влияние понижения размерности на физические явления;

квантовые физические явления, определяющие работу приборов магнитоэлектроники.

ОПК-2: Способен самостоятельно проводить экспериментальные исследования и использовать основные приемы обработки и представления полученных данных, осуществлять моделирование, анализ и эксперименты в целях проведения детального исследования для решения задач в профессиональной области

#### Знать:

ОПК-2-31 основы физики наноразмерных пленок;

# ОПК-1: Способен использовать положения, законы и методы естественных наук и математики для решения задач инженерной деятельности

#### Знать:

ОПК-1-31 тенденции и перспективы развития электроники и наноэлектроники в сфере разработки многокомпонентных гетероструктур с контролируемыми свойствами;

### ПК-5: Способность проводить анализ и выбор перспективных технологических процессов при производстве изделий микроэлектроники

#### Уметь

ПК-5-У1 готовить методологическое обоснование научного исследования и технической разработки в области магнитоэлектроники.

ОПК-2: Способен самостоятельно проводить экспериментальные исследования и использовать основные приемы обработки и представления полученных данных, осуществлять моделирование, анализ и эксперименты в целях проведения детального исследования для решения задач в профессиональной области

#### Уметь:

ОПК-2-У1 рассчитывать характеристики приборов с гетероструктурами, квантовыми ямами и барьерами;

ОПК-1: Способен использовать положения, законы и методы естественных наук и математики для решения задач инженерной деятельности

#### Уметь:

ОПК-1-У1 рассчитывать энергетические зависимости элементарных частиц и квантов исходя из их положение в объеме квантового объекта:

ПК-5: Способность проводить анализ и выбор перспективных технологических процессов при производстве изделий микроэлектроники

#### Владеть:

ПК-5-В1 Владеть навыками проведения анализа и сравнения технологических процессов при производстве изделий микроэлектроники.

ОПК-2: Способен самостоятельно проводить экспериментальные исследования и использовать основные приемы обработки и представления полученных данных, осуществлять моделирование, анализ и эксперименты в целях проведения детального исследования для решения задач в профессиональной области

#### Владеть:

ОПК-2-В1 владеть методами расчета параметров и основных характеристик моделей, используемых в предметной области.

ОПК-1: Способен использовать положения, законы и методы естественных наук и математики для решения задач инженерной деятельности

#### Владеть:

ОПК-1-В1 владеть навыками прогнозирования поведения квантовых объектов в приборах твердотельной магнитоэлектроники

	4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ							
Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Формируемые индикаторы компетенций	Литература и эл. ресурсы	Примечание	КМ	Выполн яемые работы
	Раздел 1. Гетеропереходы							
1.1	Гетероструктуры (ГС) и наиболее распространенные системы полупроводниковых материалов на основе Ge/Si и твердых растворов АЗВ5,их применение. Краткий обзор физических свойств объёмных трёхмерных (ЗD) полупроводников — зонные энергетические диаграммы электронов, плотности состояний, легирование, статистика носителей заряда, эффективные массы, подвижности и транспорт носителей заряда. /Лек/	9	6	ОПК-2-31 ОПК-2-У1	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1			
1.2	Свойства базовых соединений АШВV и структур на их основе. Простейшие гетероструктуры: получение и свойства. Расчет и оптимизация параметров гетероструктур. Формирование ОПЗ в гетеропереходе. /Пр/	9	4	ОПК-2-31 ОПК-2-В1	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1			

- 12	Tp /2 /	^		OFFICE STATE	T1 1 T1 5	1	i	
1.3	Гетеропереход /Ср/	9	11	ОПК-2-31 ОПК-2-В1	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1			
					Л2.2 Л2.3			
	D 2 5				Л2.4Л3.1			
	Раздел 2. Физические основы наноэлектроники							
2.1	Физические основы	9	7	ОПК-2-31 ПК-	Л1.1 Л1.2			
	наноэлектроники.			5-В1 ПК-5-У1	Л1.3Л2.1			
	Квантовое ограничение.			ОПК-1-31	Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1			
	Структуры малой размерности: двумерные				712.4715.1			
	(квантовые							
	ямы),одномерные							
	(квантовые нити), нульмерные (квантовые							
	точки).							
	Поведение электронов в структурах с квантовыми							
	ямами (КЯ).							
	Энергетический спектр							
	носителей в КЯ, плотность состояний, концентрация и							
	подвижность электронов в							
	двумерных системах.							
	Эффекты размерного квантования в тонких							
	пленках.							
	Влияние механических напряжений на							
	энергетический спектр							
	КЯ. /Лек/							
2.2	Denientes knavitanavita	9	4	ОПК-2-31	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1			
	Размерное квантование. Барьерные задачи в				Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3			
	квантовой механике.				Л2.4Л3.1			
	Двумерные (2D) системы - квантовые ямы (КЯ) в							
	гетероструктурах, волновые							
	функции и спектр							
	электрона в прямоугольной, треугольной и							
	параболической КЯ.							
	Транспорт носителей в							
	низкоразмерных системах. 2D системы – одиночные							
	КЯ, множественные							
	квантовые ямы (МКЯ), сверхрешётки (СР).							
	Оптическое поглощение и							
	спонтанное							
	рекомбинационное излучение в системах							
	различной размерности							
	(3D, 2D, 1D, 0D).							
	Излучательная и безизлучательная							
	рекомбинация. /Пр/							
2.3	Физические основы	9	14	ОПК-2-31	Л1.1 Л1.2			
	наноэлектроники /Ср/			ОПК-2-У1	Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3			
					Л2.4Л3.1			
	Раздел 3. Множественные							
	квантовые ямы и сверхрешетки							
	Сорарошетки						I	

3.1	Множественные квантовые ямы. Модель Кронига-Пенни. Взаимодействие двух КЯ с тонким барьером. Возникновение мини-зон, резонансное туннелированние в сверхрешетках (СР). Классификация СР. Композиционные СР, легированные СР. Электронные и оптические свойства СР. Оптическое поглощение и спонтанное рекомбинационное излучение в системах различной размерности (3D, 2D, 1D, 0D). Каналы излучательной и безизлучательной и безизлучательной рекомбинации. Электрооптические эффекты, квантоворазмерный эффект Штарка. /Лек/	9	7	ОПК-2-31 ПК- 5-31 ПК-5-В1	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1		
3.2	Расчет энергетической диаграммы легированной СР. /Пр/	9	4	ОПК-2-31 ОПК-2-У1 ПК -5-В1	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1		
3.3	Множественные квантовые ямы и сверхрешетки /Cp/	9	12	ОПК-2-31 ОПК-1-31	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1		
	Раздел 4. Физика эпитаксиальных процессов						

4.4			-	OFFICA 2.5	п п	1	
4.1	Физика эпитаксиальных	9	7	ОПК-2-31	Л1.1 Л1.2		
	процессов. Современные			ОПК-2-У1	Л1.3Л2.1		
	технологии получения			ОПК-1-31	Л2.2 Л2.3		
	полупроводниковых тонких				Л2.4Л3.1		
	пленок и наногетероструктур.						
	Молекулярно-лучевая						
	эпитаксия (МЛЭ) элементарных						
	_						
	полупроводников и полупроводников на основе						
	соединений АЗВ5.						
	Эпитаксия из						
	металлоорганических						
	соединений и летучих						
	неорганических гидридов						
	(МОСVD).						
	Рассогласованные						
	гетероэпитаксиальные						
	системы. Получение						
	псевдоморфных						
	гетероструктур.						
	Особенности выращивания						
	эпитаксиальных пленок						
	нитридов бинарных						
	соединений АЗВ5.						
	Основные ростовые						
	процессы на поверхности						
	твердых тел: Адсорбция,						
	поверхностная диффузия и						
	десорбция атомов в тонких						
	пленках.						
	Зародышеобразование при						
	выращивании						
	эпитаксиальных пленок						
	бинарных соединений						
	АЗВ5. Понятие						
	критического зародыша.						
	Слияние островков и						
	образование сплошной						
	двумерной (2D) пленки.						
	Элементы самоорганизации						
	при						
	гетероэпитаксии.Самоорган						
	изованный рост.						
	полупроводниковых						
	материалов для						
	выращивания структур с						
	КТ. Пример						
	полупроводниковых систем						
	InAs/GaAs(100) и Ge/Si						
	(100). Средний размер и						
	поверхностная плотность						
	КТ. Трехмерные массивы						
	когерентно-напряженных						
	островков. Формирование						
	полупроводниковых						
	квантово-размерных						
	структур /Лек/						
4.2	Молекулярно-лучевая	9	2	ОПК-2-31	Л1.1 Л1.2		
	эпитаксия и эпитаксия из				Л1.3Л2.1		
	металлоорганических				Л2.2 Л2.3		
	соединений (MOCVD).				Л2.4Л3.1		
	полупроводников на основе						
	соединений АЗВ5.						
	Сравнение двух						
	методик. /Пр/						

4.3	Физика эпитаксиальных процессов. Реферат. /Ср/	9	10	ОПК-2-31	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1		
	Раздел 5. Приборы микро- и наноэлектроники на основе низкоразмерных структур полупроводников						
5.1	Приборы микро- и наноэлектроники на основе низкоразмерных структур полупроводников. Реализация приборов с КЯ. Резонансный туннельный диод: Светодиоды с гетеропереходами и активной областью в виде 3D — слоя, одиночной КЯ, множественных КЯ на основе соединений и твёрдых растворов в системах AlGaInP и AlGaInN. Излучающие диоды для ультрафиолетовой области спектра на основе системы AlGaInN. Инжекционные гетеролазеры с КЯ на основе соединений и твёрдых растворов A3B5: геометрия, зонная диаграмма, пороговый ток. Лазеры с боковым и вертикальным выводом излучения. /Лек/	9	7	ОПК-2-31	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1		
5.2	Излучающие диоды с гетеропереходами и активной областью в виде 3D – слоя, одиночной КЯ, множественных КЯ, массива КТ на основе соединений и твёрдых растворов АЗВ5: Полевые транзисторы с двумерным электронным газом: на основе гетероструктуры AlGaN /GaN с высокой подвижностью электронов в канале(HEMT). Эффект поляризации. Частотные, мощностные характеристики, выбор оптимальной топологии. Контрольная работа. /Пр/	9	3	ОПК-2-31	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1		
5.3	Приборы микро- и наноэлектроники на основе низкоразмерных структур полупроводников. Реферат. /Ср/	9	10	ОПК-2-31	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1		

5.	5.1. Контрольные мероприятия (контрольная работа, тест, коллоквиум, экзамен и т.п), вопросы для самостоятельной подготовки					
Код КМ	Контрольное мероприятие	Проверяемые индикаторы компетенций	Вопросы для подготовки			
KM1	Контрольная работа 1. Физические основы наноэлектроники, Гетеропереходы, Множественные квантовые ямы и сверхрешетки	ОПК-2-31;ОПК-2- У1;ОПК-2-В1;ОПК -1-31;ОПК-1- У1;ОПК-1-В1;ПК-5 -31;ПК-5-У1;ПК-5- В1	Физические основы наноэлектроники.  Квантовое ограничение. Структуры малой размерности: двумерные (квантовые ямы),одномерные (квантовые нити), нульмерные (квантовые точки).  Поведение электронов в структурах с квантовыми ямами (КЯ).  Энергетический спектр носителей в КЯ, плотность состояний, концентрация и подвижность электронов в двумерных системах.  Эффекты размерного квантования в тонких пленках.  Влияние механических напряжений на энергетический спектр КЯ.  Гетероструктуры (ГС) и наиболее распространенные системы полупроводниковых материалов на основе Ge/Si и твердых растворов АЗВ5,их применение. Краткий обзор физических свойств объёмных трёхмерных (ЗD) полупроводников — зонные энергетические диаграммы электронов, плотности состояний, легирование, статистика носителей заряда, эффективные массы, подвижности и транспорт носителей заряда.  Множественные квантовые ямы. Модель Кронига- Пенни.  Взаимодействие двух КЯ с тонким барьером. Возникновение минизон, резонансное туннелированние в сверхрешетках (СР).  Классификация СР. Композиционные СР, легированные СР.  Электронные и оптические свойства СР.  Оптическое поглощение и спонтанное рекомбинационное излучение в системах различной размерности (ЗD, 2D, 1D, 0D).  Каналы излучательной и безизлучательной рекомбинации.  Электрооптические эффекты, квантово- размерный эффект Штарка			
KM2	Контрольная работа 2. Физика эпитаксиальных процессов, Приборы микро- и наноэлектроники на основе низкоразмерных структур полупроводников	ОПК-2-31;ОПК-2- В1;ОПК-1-31;ОПК- 2-У1;ПК-5-31;ОПК -1-В1;ОПК-1- У1;ПК-5-У1;ПК-5- В1	Физика эпитаксиальных процессов. Современные технологии получения полупроводниковых тонких пленок и наногетероструктур. Молекулярно-лучевая эпитаксия (МЛЭ) элементарных полупроводников и полупроводников на основе соединений АЗВ5. Эпитаксия из металлоорганических соединений и летучих неорганических гидридов (МОСVD). Рассогласованные гетероэпитаксиальные системы. Получение псевдоморфных гетероструктур. Особенности выращивания эпитаксиальных пленок нитридов бинарных соединений АЗВ5. Основные ростовые процессы на поверхности твердых тел: Адсорбция, поверхностная диффузия и десорбция атомов в тонких пленках. Зародышеобразование при выращивании эпитаксиальных пленок бинарных соединений АЗВ5. Понятие критического зародыша. Слияние островков и образование сплошной двумерной (2D) пленки. Элементы самоорганизации при гетероэпитаксии.Самоорган изованный рост. полупроводниковых материалов для выращивания структур с КТ. Пример полупроводниковых систем InAs/GaAs(100) и Ge/Si(100). Средний размер и поверхностная плотность КТ. Трехмерные массивы когерентно-напряженных островков. Формирование полупроводниковых квантово-размерных структур Приборы микро- и наноэлектроники на основе низкоразмерных структур полупроводников. Реализация приборов с КЯ. Резонансный туннельный диод: Светодиоды с гетеропереходами и активной областью в виде 3D — слоя, одиночной КЯ, множественных КЯ на основе соединений и твёрдых растворов в системах AlGaInP и AlGaInN. Излучающие диоды для ультрафиолетовой области спектра на основе соединений и твёрдых растворов АЗВ5: геометрия, зонная диаграмма, пороговый ток. Лазеры с боковым и вертикальным выводом излучения.			
5.2. Пере	чень работ, выполняе	мых по дисциплине (	(Курсовая работа, Курсовой проект, РГР, Реферат, ЛР, ПР и т.п.)			
Код работы	Название работы	Проверяемые индикаторы компетенций	Содержание работы			

P1	Курсовая работа.	ОПК-2-31;ОПК-2-	1) Механизмы проводимости твердых тел.
		В1;ОПК-1-31	2) Типы квантовых ям. Зонная структура в квантовой яме.
			3) Полупроводниковые сверхрешёточные структуры.
			4) Легированные сверхрешетки.
			5) Легированные гетероструктуры. Дефекты
			эпитаксиальных слоев.
			6) Физика эпитаксиальных процессов.
			7) Псевдоаморфные гетероструктуры на GaAs.
			8) Метаморфные гетероструктуры на GaAs, InP HEMT.
			9) Гетероструктуры в солнечной энергетике.
			10) Гетероструктурные светоизлучающие приборы.
			11) Полевые гетеротранзисторы на материалах A3N.
			12) Механизмы формирования гетероэпитаксиальных
			структур с квантовыми точками.
			13) Самоорганизация при эпитаксии.
			14) Процессы переноса в наноструктурах в электрических
			полях.
			15) Приборы на основе использования массивов квантовых
			точек.
			16) Формирование гетеробиполярных транзисторных
			структур.
			17) Оптимизация гетероструктуры с квантовой ямой.
			18) Получение и использование варизонных гетероструктур.
			19) Влияние поляризационных эффектов и поверхностных
			состояний на характеристики полевых GaN гетеротранзисторов.
			20) Приборные применения сверхрешеточных структур.
P2	Контрольная	ОПК-1-В1;ПК-5-	Гетероструктуры.
	работа 1.	31;ПК-5-У1	Структуры малой размерности.
			Поведение электронов в структурах с квантовыми ямами. Модель
			Кронига- Пенни.
			Сверхрешетки.
P3	Контрольная	ОПК-1-31;ОПК-2-	Физика эпитаксиальных процессов.
	работа 2.	В1;ОПК-2-У1;ОПК	Современные технологии получения полупроводниковых тонких
		-2-31;ОПК-1-	пленок и наногетероструктур.
		У1;ОПК-1-В1;ПК-5	Приборы микро- и наноэлектроники на основе низкоразмерных
		-31;ПК-5-У1;ПК-5-	структур полупроводников.
		B1	
<b></b>			<u> </u>

5.3. Оценочные материалы, используемые для экзамена (описание билетов, тестов и т.п.)

Экзамен не предусмотрен.

#### 5.4. Методика оценки освоения дисциплины (модуля, практики. НИР)

По дисциплине проводится аттестация. Аттестация предусмотрена в форме зачета с оценкой. Обучающийся для получения зачета должен выполнить все работы, указанные в данном разделе. Оценка формируется как среднеарифметическая из оценок за текущие контрольные, практические и самостоятельные работы.

#### 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 6.1. Рекомендуемая литература 6.1.1. Основная литература Авторы, составители Заглавие Библиотека Издательство, год Л1.1 Борисенко В. Е. Наноэлектроника: теория и Электронная библиотека Москва: БИНОМ. практика: учебник Лаборатория знаний, 2015 Л1.2 Шишкин Г. Г., Агеев Наноэлектроника: элементы, Москва: БИНОМ. Электронная библиотека И. М. приборы, устройства: Лаборатория знаний, 2015 учебное пособие Л1.3 Ковалев А. Н., М.: Изд-во МИСиС, 2015 Физика и технология Электронная библиотека Рабинович О. И., наноструктурных Тимошина М. И. гетерокомпозиций: учебник 6.1.2. Дополнительная литература Библиотека Авторы, составители Заглавие Издательство, год Томск: ТУСУ□, 2016 Л2.1 Дробот П. Н. Наноэлектроника: учебное Электронная библиотека пособие

	Авторы, составители	Заглавие	Библиотека	Издательство, год
Л2.2	Ковалев Алексей Николаевич	Гетероструктурная наноэлектроника: учеб. пособие	Библиотека МИСиС	М.: Изд-во МИСиС, 2009
Л2.3	Ковалев Алексей Николаевич	Твердотельная электроника: учеб. пособие	Библиотека МИСиС	М.: Изд-во МИСиС, 2010
Л2.4	Ковалев А. Н.	Транзисторы на основе полупроводниковых гетероструктур: монография	Библиотека МИСиС	М.: Изд-во МИСиС, 2011
		6.1.3. Методич	еские разработки	
	Авторы, составители	Заглавие	Библиотека	Издательство, год
Л3.1	Кузнецов Геннадий Дмитриевич, Курочка Сергей Петрович, Кушхов Аскер Русланович, др.	Процессы микро- и нанотехнологии. Ионно- плазменные процессы: лаб. практикум	Библиотека МИСиС	М.: Учеба, 2007
		6.3 Перечень прогр	аммного обеспечения	
П.1	Win Pro 10 32-bit/64-bit	t		
П.2	Microsoft Office			
П.3	WinRAR			
П.4	LMS Canvas			
П.5	MS Teams			
П.6	ESET NOD32 Antiviru	s		
11.0		<u>ы информационных справочн</u>	ых систем и профессионал	ьных баз данных

	7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ						
Ауд.	Назначение	Оснащение					
Любой корпу Мультимедийная	с Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и/или для проведения практических занятий:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
Любой корпу Мультимедийная	с Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и/или для проведения практических занятий:						
Читальный за электронных ресурсов		комплект учебной мебели на 55 мест для обучающихся, 50 ПК с доступом к ИТС «Интернет», ЭИОС университета через личный кабинет на платформе LMS Canvas, лицензионные программы MS Office, MS Teams, ESET Antivirus.					

#### 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Дисциплина относится к точным наукам и требует значительного объема самостоятельной работы. Отдельные учебные вопросы выносятся на самостоятельную проработку и контролируются посредством текущей аттестации. При этом организуются групповые и индивидуальные консультации.

Лекционные занятия нацелены на изучение студентами физики квантоворазмерных полупроводниковых гетерокомпозиций. Практические занятия нацелены на изучение характеристик приборов на основе квантоворазмерных полупроводниковых гетерокомпозиций, особенностей их производства и применения.

Проведение аудиторных занятий предусматривает использование в учебном курсе активных и интерактивных технологий:

- проведение лекций с использованием интерактивных и мультимедийных технологий (презентация в формате MS PowerPoint);
- при проведении практических занятий допускается использование проприетарного ПО, входящего в состав технологического и исследовательского оборудования.

Образовательная деятельность по дисциплине реализуется с помощью электронной информационно-образовательной среды НИТУ «МИСиС» Canvas.

В учебном процессе используются программные базы вуза и автоматизированные средства взаимодействия преподавателя и обучающегося. Электронный контент в Canvas содержит все календарные события курса, навигационные ссылки, тесты, задания, методические рекомендации и электронные материалы.

По курсу предусмотрено